

課題番号 : F-13-TU-0121
利用形態 : 機器利用
利用課題名 (日本語) : MEMS を用いた光デバイスの開発
Program Title (English) : Development of the optical device using MEMS
利用者名 (日本語) : 藤村 康浩
Username (English) : Y. Fujimura
所属名 (日本語) : 東北大学大学院工学研究科バイオロボティクス専攻
Affiliation (English) : Department of Bioengineering and Robotics, Graduate School of Engineering,
Tohoku University

1. 概要 (Summary)

PZT を用いた MEMS アクチュエータを作成する。

4. その他・特記事項 (Others)

なし

2. 実験 (Experimental)

エッチングチャンバー内に設置した成膜装置を用いて、ゾルゲル法により PZT 成膜を実施した。

使用装置

エッチングチャンバー一式

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許 (Patent)

なし

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

作成した膜 : 膜厚 $2\mu\text{m}$

膜の特性について

Fig.1 に示すように、XRD で配向性を確認したが、求める配向性は得られている模様。

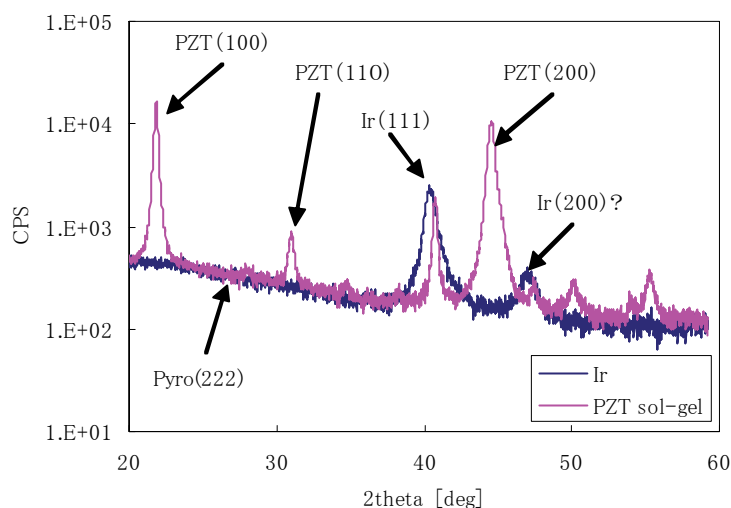


Fig. 1 XRD result of deposited PZT film